Docket No.: 50395-237 PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of : Customer Number: 20277

Kazuya KUWAHARA, et al. : Confirmation Number:

Serial No.: : Group Art Unit:

Filed: November 04, 2003 : Examiner:

For: METHOD OF DRAWING OPTICAL FIBER AND APPARATUS FOR IMPLEMENTING THE METHOD

CLAIM OF PRIORITY AND TRANSMITTAL OF CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT

Mail Stop CPD Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In accordance with the provisions of 35 U.S.C. 119, Applicants hereby claim the priority of:

Japanese Patent Application No. JP 2002-329914, filed on November 13, 2002.

cited in the Declaration of the present application. A certified copy is submitted herewith.

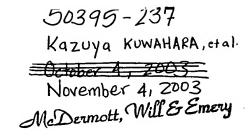
Respectfully submitted,

MCDERMOTT, WILL & EMERY

Registration No. 26,106

600 13th Street, N.W. Washington, DC 20005-3096 (202) 756-8000 AJS:gav Facsimile: (202) 756-8087

Date: November 4, 2003



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2002年11月13日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-329914

[ST. 10/C]:

[J P 2 0 0 2 - 3 2 9 9 1 4]

出 願 人
Applicant(s):

住友電気工業株式会社

2003年 8月 8日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

102Y0494

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

C03B 37/025

G02B 6/02

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会

社横浜製作所内

【氏名】

桑原 一也

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会

社横浜製作所内

【氏名】

千種 佳樹

【特許出願人】

【識別番号】

000002130

【氏名又は名称】

住友電気工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100099195

【弁理士】

【氏名又は名称】

宮越 典明

【選任した代理人】

【識別番号】

100116182

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 照雄

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

030889

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 0203456

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光ファイバの線引き方法及び線引き装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 線引き炉内に光ファイバ母材を送り込みながら該光ファイバ母材の先端部を加熱して光ファイバを線引きする方法において、前記光ファイバ母材にガスを吹き付け、前記線引き炉の上部のシールリングと前記光ファイバ母材との隙間から前記ガスを前記線引き炉の外部に出すことにより前記線引き炉内をシールしており、

前記光ファイバ母材の外径に従って前記シールリングの内径を変化させること を特徴とする光ファイバの線引き方法。

【請求項2】 線引き開始前に、予め前記光ファイバ母材の外径を測定しておき、測定された母材外径情報と、前記線引き炉と前記光ファイバ母材の上下方向の相対位置の関係に基づいて前記シールリングの内径を制御することを特徴とする請求項1に記載した光ファイバの線引き方法。

【請求項3】 前記シールリングの直上の前記光ファイバ母材の外径を測定し、この測定結果に基づいて前記シールリングの内径を制御することを特徴とする請求項1に記載した光ファイバの線引き方法。

【請求項4】 前記シールリングの内径と前記光ファイバ母材の外径との差が一定となるように前記シールリングの内径を制御することを特徴とする請求項 1から3のいずれか1項に記載した光ファイバの線引き方法。

【請求項5】 前記シールリングと前記光ファイバ母材との間の隙間面積が一定になるように前記シールリングの内径を制御することを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載した光ファイバの線引き方法。

【請求項6】 線引き炉内に光ファイバ母材を送り込みながら該光ファイバ母材の先端部を加熱して光ファイバを線引きする方法において、前記光ファイバ母材にガスを吹き付け、前記線引き炉の上部のシールリングと前記光ファイバ母材との隙間から前記ガスを前記線引き炉の外部に出すことにより前記線引き炉内をシールしており、線引き炉内に配置した炉心管の内圧が一定となるように前記シールリングの内径を制御することを特徴とする光ファイバの線引き方法。

【請求項7】 前記光ファイバ母材の中心が前記シールリングの中心から偏心した場合には、前記光ファイバ母材の中心が前記シールリングの中心と一致するように当該シールリングを移動させることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載した光ファイバの線引き方法。

【請求項8】 線引き炉内に光ファイバ母材を送り込みながら該光ファイバ母材の先端部を加熱して光ファイバを線引きする装置において、

前記光ファイバ母材にガスを吹き付け可能なガス供給手段とシールリングから 成るガスシール機構と、

前記シールリングの内径を変化させるシールリング駆動装置と、

このシールリング駆動装置を制御するシールリング駆動装置制御機構とを備えていることを特徴とする光ファイバの線引き装置。

【請求項9】 前記シールリングの直上における前記光ファイバ母材の外径 を測定する母材外径測定手段を備え、

この母材外径測定手段による測定結果に基づいて、前記シーリング駆動装置制御機構が前記シーリング駆動装置を制御して前記シールリングの内径を調整することを特徴とする請求項8に記載した光ファイバの線引き装置。

【請求項10】 線引き炉内に光ファイバ母材を送り込みながら該光ファイバ母材の先端部を加熱して光ファイバを線引きする装置において、

前記光ファイバ母材にガスを吹き付け可能なガス供給手段とシールリングから 成るガスシール機構と、

前記シールリングの内径を変化させるシールリング駆動装置と、

このシールリング駆動装置を制御するシールリング駆動装置制御機構と、

前記線引き炉の内圧を測定する内圧測定手段とを備え、

この内圧測定手段による測定結果に基づいて、前記シーリング駆動装置制御機構が前記シーリング駆動装置を制御して前記シールリングの内径を調整することを特徴とする請求項8に記載した光ファイバの線引き装置。

【請求項11】 前記光ファイバ母材の中心が前記シールリングの中心から 偏心した場合に、前記光ファイバ母材の中心が前記上部シールリングの中心と一 致するように当該シールリングを移動させるシールリング移動装置を備えている ことを特徴とする請求項8から10のいずれか1項に記載した光ファイバの線引き装置。

【発明の詳細な説明】

[00001]

【発明の属する技術分野】

この発明は、ガスシールにより光ファイバの線引きを安定して行うことのできる光ファイバの線引き方法及び線引き装置に関する。

[00002]

【従来の技術】

光ファイバは、石英等の材料で製造した母材を線引き装置の上部から供給し、 線引き炉において先端部を加熱溶融し、母材の先端から下方に引き出して細径化 することにより製造されている。

ところで、線引き炉内の炉心管や発熱体としては、カーボンが広く用いられているが、カーボンを使用する場合には、炉内材質の酸化劣化を防止するために、炉内は不活性ガス雰囲気とする必要がある。一方、光ファイバの長手方向の均一性を確保するために、線引きする母材の表面は清浄に保つ必要がある。この2点を満たすために、線引き炉の炉心管と母材の間には一定の隙間を設け、その隙間に不活性ガスを注入することで炉内の酸化を防止するガスシール構造を採用する場合が多い(例えば特許文献1参照。)。

[0003]

ガスシールは通常、線引き炉の上端で不活性ガスを母材に吹き付ける形で行われる。吹き出された不活性ガスは、母材に当たって上方へ流れる上昇流と下方に流れる下降流とに分かれる。このうち、上昇流が母材と炉心管の隙間から酸素が侵入するのを防止する。また、下降流が炉内の熱による上昇流を抑えて下降流とし、線引き炉下部に設置されたシャッターから放出することにより下方からの酸素の侵入を防止する。このようなガスの流れにより、線引き炉内は大気圧に対して常に陽圧に保たれる。

[0004]

【特許文献1】

特開昭62-176938号公報(3頁、第1図)

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上述したようなガスシール構造を採用する場合には、ガス吹き出し口と母材との隙間の変動量を小さく抑える必要がある。これは、前記隙間が変動すると、ガスシールから吹き出されたガスの上昇流と下降流の比率が変化するためである。すなわち、母材径が細くなり隙間が大きくなると、上方へ逃げる割合が増加し、下方に流れる割合が少なくなる。その結果、下降流の流速が低下するため、炉内の熱による上昇気流を抑制できず、ガスの流れが不安定になり、母材の外径変動が増大したり、下シャッターの一部から外気が混入し、炉内が酸化劣化し易くなる問題が生じる。

[0006]

この傾向は母材径が太くなるほど顕著であり、母材径が細い場合と比較すると 、わずかな母材外径の変化でも、ガスシール部のクリアランスの面積変化が相対 的に大きくなり安定して線引きを行うことができなくなる。

[0007]

図10には光ファイバ母材の長手方向に対する光ファイバ母材の外径の変化の例が示されている。また図11には、その母材を炉心管の内径 ϕ 80mm、上部シールリングの内径 ϕ 72mmの条件で線引きした場合の外径の測定結果が示されている。母材外径が ϕ 69mmまで細くなるとガラス径変動が増大する現象を確認した。さらに ϕ 68mm近傍になると、変動幅 5 μ m以上の突発的なガラス外径変動を生じ、線引き終了後に炉内の状態を確認すると、カーボン炉心管の内面に酸化痕を認めることができた。なお、図11中、×印は、突発的ガラス外径変動の発生を示している。

[00008]

本発明の目的は、ガスシールを確実にした状態で、ガスシール線引きを安定して行うことのできる光ファイバの線引き方法及び線引き装置を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】

前述した目的を達成するために、本発明にかかる光ファイバの線引き方法は、 線引き炉内に光ファイバ母材を送り込みながら該光ファイバ母材の先端部を加熱 して光ファイバを線引きする方法において、前記光ファイバ母材にガスを吹き付 け、前記線引き炉の上部のシールリングと前記光ファイバ母材との隙間から前記 ガスを前記線引き炉の外部に出すことにより前記線引き炉内をシールしており、 前記光ファイバ母材の外径に従って前記シールリングの内径を変化させることを 特徴としている。このような線引き炉のシール方式をガスシールと呼ぶ。

[0010]

このように構成された光ファイバの線引き方法においては、光ファイバ母材に ガスを吹き付けると共に、シールリングにより線引き炉内をシールし、この線引き炉内に光ファイバ母材を送り込みながら光ファイバ母材の先端部を加熱溶融し て光ファイバを製造する際に、線引き炉に供給される光ファイバ母材の外径に従ってシールリングの内径を変化させながらガスを吹き付ける。このため、光ファイバ母材の外径が変化しても、光ファイバ母材とシールリングとの隙間を一定に 保つことができるので、安定して線引きを行うことができる。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

また、本発明にかかる光ファイバの線引き方法は、線引き開始前に、予め前記 光ファイバ母材の外径を測定しておき、測定された母材外径情報と、前記線引き 炉と前記光ファイバ母材の上下方向の相対位置の関係に基づいて前記シールリン グの内径を制御することが望ましい。

$[0\ 0\ 1\ 2]$

また、本発明にかかる光ファイバの線引き方法は、前記シールリングの直上の前記光ファイバ母材の外径を測定し、この測定結果に基づいて前記シールリングの内径を制御することが望ましい。

[0013]

また、本発明にかかる光ファイバの線引き方法は、前記シールリングの内径と前記光ファイバ母材の外径との差が一定となるように前記シールリングの内径を制御することが望ましい。

[0014]

また、本発明にかかる光ファイバの線引き方法は、前記シールリングと前記光ファイバ母材との間の隙間面積が一定になるように前記シールリングの内径を制御することが望ましい。

[0015]

また、本発明にかかる光ファイバの線引き方法は、線引き炉内に光ファイバ母材を送り込みながら該光ファイバ母材の先端部を加熱して光ファイバを線引きする方法において、前記光ファイバ母材にガスを吹き付け、前記線引き炉の上部のシールリングと前記光ファイバ母材との隙間から前記ガスを前記線引き炉の外部に出すことにより前記線引き炉内をシールしており、線引き炉内に配置した炉心管の内圧が一定となるように前記シールリングの内径を制御することを特徴としている。

[0016]

また、本発明にかかる光ファイバの線引き方法は、前記光ファイバ母材の中心が前記上部シールリングの中心から偏心した場合には、前記光ファイバ母材の中心が前記上部シールリングの中心と一致するように当該シールリングを移動させることが望ましい。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

また、本発明にかかる光ファイバの線引き装置は、線引き炉内に光ファイバ母材を送り込みながら該光ファイバ母材の先端部を加熱して光ファイバを線引きする装置において、前記光ファイバ母材にガスを吹き付け可能なガス供給手段とシールリングから成るガスシール機構と、前記シールリングの内径を変化させるシールリング駆動装置と、このシールリング駆動装置を制御するシールリング駆動装置制御機構とを備えていることを特徴としている。

[0018]

また、本発明にかかる光ファイバの線引き装置は、前記シールリングの直上に おける前記光ファイバ母材の外径を測定する母材外径測定手段を備え、この母材 外径測定手段による測定結果に基づいて、前記シーリング駆動装置制御機構が前 記シーリング駆動装置を制御して前記上部シールリングの内径を調整することが 望ましい。

[0019]

また、本発明にかかる光ファイバの線引き装置は、線引き炉内に光ファイバ母材を送り込みながら該光ファイバ母材の先端部を加熱して光ファイバを線引きする装置において、前記光ファイバ母材にガスを吹き付け可能なガス供給手段とシールリングから成るガスシール機構と、前記シールリングの内径を変化させるシールリング駆動装置と、このシールリング駆動装置を制御するシールリング駆動装置制御機構と、前記線引き炉の内圧を測定する内圧測定手段とを備え、

この内圧測定手段による測定結果に基づいて、前記シーリング駆動装置制御機構が前記シーリング駆動装置を制御して前記シールリングの内径を調整することを特徴としている。

[0020]

また、本発明にかかる光ファイバの線引き装置は、前記光ファイバ母材の中心が前記シールリングの中心から偏心した場合に、前記光ファイバ母材の中心が前記シールリングの中心と一致するように当該シールリングを移動させるシールリング移動装置を備えていることが望ましい。

[0021]

【発明の実施の形態】

以下、本発明に係る光ファイバの線引き方法及び線引き装置の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。

[0022]

図1には、本発明の実施形態に係る光ファイバの線引き装置の全体が示されている。この線引き装置10では、線引き炉20の上方に母材供給機構11が設けられており、チャック12によって光ファイバ母材30の上部に取付けられているガラス棒31を把持している。従って、供給機構11の下降により、チャック12に把持された光ファイバ母材30が線引き炉20に供給される。

[0023]

線引き炉20の上部には、線引き炉20に供給される光ファイバ母材30の外径を測定する非接触式の母材外径測定器13が設けられている。また、母材外径

測定器13の下方で線引き炉20の上部には、線引き炉20の内部を外部からシールするための上部シールリング14Uが設けられている。上部シールリング14Uの下側には、線引き炉20の内部にAr、N、He等の不活性ガス15を吹き込むガス供給器16が設けられている。

なお、母材外径測定機13を複数設置すると、光ファイバ母材30の中心軸の 位置変化量を計測することもできる。

[0024]

上部シールリング14Uは、図2及び図3に示すように、いわゆるアイリス絞り14aにより構成されている。このアイリス絞り14aをシールリング駆動装置14bにより駆動して、光ファイバ母材30が通過する中央の開口部14cの大きさを調整することができるようになっている。図2には、細径の光ファイバ母材30に対する上部シールリング14Uが示されている。また、図3には、太径の光ファイバ母材30に対する上部シールリング14Uが示されている。さらに、図4に示すように、線引き炉20に供給される光ファイバ母材30が偏心している場合には、アイリス絞り14aを支持しているベースプレート14dを、シールリング移動装置14eにより前後左右に移動させて、光ファイバ母材30が上部シールリング14Uの中央を通過するようにする。

[0025]

図1に戻って、線引き炉20の中央には光ファイバ母材30が通過する円筒形のカーボンからなる炉心管21が設けられており、この炉心管21の外側には誘導炉や抵抗炉における発熱体22が設けられている。

線引き炉20の下部には内圧測定手段としての差圧計23が設けられており、 線引き炉20内部の圧力と、外部の大気圧との差を検出するようになっている。 そして、線引き炉20の下端部には前述の上部シールリング14Uと対を成す下 シャッター14Lが設けられている。

[0026]

線引き炉20の下方には、線引きされたガラスファイバ40aを冷却する冷却管50が設けられており、その下側にはガラスファイバ40aの外径を測定するための線引き後外径測定器51が設けられている。

[0027]

線引き後外径測定器51の下方には、線引きされたガラスファイバ40aに第1層目の被覆を施すために被覆材を塗布する第1塗布部52aと、この第1塗布部52aに連続して、第2層目の被覆を施すために被覆材を塗布するための第2塗布部52bとが設けられている。第2塗布部52bの下流には、ガラスファイバ40aに塗布された第1層目と第2層目の被覆を一括で硬化させるための硬化部53が設けられている。例えば、UV樹脂(紫外線硬化性樹脂)により被覆を行う場合には、ガラスファイバ40aに第1塗布部52aにおいて第1層目のUV樹脂を塗布し、続いて、第2塗布部52bで、第2層目のUV樹脂を塗布し、その下流の硬化部53では、UVランプにより紫外線を照射して硬化させる。あるいは、被覆として、熱硬化性樹脂を用いた場合には、硬化部53には加熱装置を用い、熱硬化性樹脂を加熱して硬化させる。

[0028]

このようにして、線引きされ、被覆された光ファイバ40bは、ガイドローラ 54を介して、キャプスタン55により引っ張られ、最後に巻き取りドラム57 に巻きとられて製品化する。

[0029]

なお、母材供給機構11、母材外径測定器13、シールリング駆動装置14b、シールリング移動装置14e、発熱体22、差圧計23、線引き後外径測定器51、駆動ローラ55等は、シールリング駆動装置制御機構でもあるコントローラ60に接続されており、測定信号のフィードバックや、駆動指令信号等のやり取りを行っている。

[0030]

次に、図1に基づいて、本発明の実施形態に係る光ファイバの線引き方法について説明する

コントローラ60は母材供給機構11を制御して、光ファイバ母材30を下降させて線引き炉20に供給する。供給される光ファイバ母材30の外径は母材外径測定器13により測定されて、コントローラ60に送られる。コントローラ60では、送られてきたファイバ母材30の外径測定値に基づいて、シールリング

駆動装置14bを制御し、上部シールリング14Uの内径と光ファイバ母材30の外径との差が一定になるようにアイリス絞り14aを調整する。

[0031]

線引き炉20の内部にはガス供給機構11により不活性ガス15が吹き出されており、光ファイバ母材30に吹き付けられている。光ファイバ母材30に当たった不活性ガス15は、上昇流15Uと下降流15Lとに分岐し、上昇流15Uは上部シールリング14Uと光ファイバ母材30との間の隙間から、外部に放出される。これにより、外部の空気や塵等が線引き炉20に侵入するのを防止している。

一方、下降流15Lは、光ファイバ母材30と炉心管21との間を下方へ流れる。これにより、光ファイバ母材30の表面に塵等の不純物が付着するのを防止すると共に、炉心管21が酸素に触れて酸化するのを防止している。

[0032]

線引き炉20から引き出されたガラスファイバ40aは、下側のシールリング14Lを通過して、冷却管50において冷却される。その後外径測定器51によりガラスファイバ40aの外径を測定し、コントローラ60にフィードバックする。コントローラ60では、フィードバックされた外径測定値に基づいて、発熱体22を制御する。例えば測定された外径が細すぎる場合には、発熱体22の温度を下げ、外径が太すぎる場合には発熱体22の温度を上昇させる。

[0033]

続いて、ガラスファイバ40aは、第1、第2塗布部52a、53bにより被 覆材が塗布され、硬化部53により硬化して被覆が形成される。

このようにして製造された光ファイバ40bは、ガイドローラ54を介してキャプスタン55により引っ張られ、巻き取りドラム57に巻きとられる。

[0034]

図5には種々の光ファイバ母材30について、長手方向の外径の変化が示されている。

図6には、図5における母材Aについて、前述した光ファイバ母材30の外径 測定値に基づいて、コントローラ60がシールリング駆動装置14bを制御し、 光ファイバ母材30の外径と、上部シールリング14Uの内径との差が一定になるようにアイリス絞り14aを調整して線引きした場合の光ファイバ40aの外径変動の幅が示されている。ここで、外径変動の幅とは、各測定点(図にプロットされた点)を含む長さ1000mmの範囲での実測外径と測定外径との差の最大値をいう。

外径測定器 13の位置から上部シールリング 14 Uの位置まで、光ファイバ母材 30 が移動するのに必要な時間は、光ファイバ母材 30 の送り速度によって決まる。光ファイバ母材 30 の外径が測定されてから、その時間分だけ遅らせて、上部シールリング 14 Uの内径を調整する。

この場合には、図6から明らかなように、光ファイバ母材30の全長にわたって安定した線引きを行うことができる。

[0035]

図7には、図5における母材Bについて、上部シールリング14Uと光ファイバ母材30の隙間面積が一定となるように、コントローラ60がシールリング駆動装置14bを制御してアイリス絞り14aを調整し線引きした場合の光ファイバ40aの外径変動の幅が示されている。この場合には、図7から明らかなように、光ファイバ母材30の全長にわたって安定した線引きを行うことができることがわかった。

(0036)

図8には、図5における母材Cについて、予め測定されている光ファイバ母材30の外径(図5参照)に基づいて、コントローラ60がシールリング駆動装置14bを制御してアイリス絞り14aを調整し線引きした場合の光ファイバ40aの外径変動の幅が示されている。

図5に示す母材位置0の箇所が、上部シールリング14Uの位置に来たときからシールリングの内径の調整を開始する。光ファイバ母材30の送り速度と、図5に示す母材の外径情報からある時刻における上部シールリング14Uの位置にある光ファイバ母材30の外径が求まるので、その外径値に合わせて上部シールリング14Uの内径を調整する。この場合には、図8から明らかなように、光ファイバ母材30の全長にわたって安定した線引きを行うことができることがわか

った。

[0037]

線引き炉20において、コントローラ60により制御される発熱体22により、光ファイバ母材30の下端部が加熱されて溶融され、線引きされてガラスファイバ40aとなる。このときの線引き炉20の内圧は差圧計23により計測されてコントローラ60に送られ、コントローラ60は、線引き炉20内部の圧力によって上部シールリング14Uの内径を調整する。このとき、線引き炉内に供給するガスの量を変えて線引き炉の内圧を一定にしてもよい。

[0038]

図9には、図5における母材Dについて、上部シールリング14Uと光ファイバ母材30との隙間を2mmに設定したときの線引き炉20の内圧を基準とし、線引き時における線引き炉20の内圧が一定となるように、コントローラ60がシールリング駆動装置14bを制御してアイリス絞り14aを調整し線引きした場合の光ファイバ40aの外径変動の幅が示されている。この場合には、図9から明らかなように、光ファイバ母材30の全長にわたって安定した線引きを行うことができることがわかった。

[0039]

なお、上述した種々の方法による上部シールリング14Uの内径調整において、光ファイバ母材30の長手方向の変形により上部シールリング14Uの中心から偏心している場合には、図4において前述したように、コントローラ60によりシールリング移動装置14eを制御して上部シールリング14Uを移動させ、光ファイバ母材30が上部シールリング14Uの中心を通るようにすると、光ファイバ母材30が上部シールリング14Uの中心をはずれて上部シールリング14Uに接触することがない。したがって、一層安定した線引きを行うことができる。

[0040]

以上、前述した光ファイバの線引き方法及び線引き装置によれば、光ファイバ 母材30の外径が長手方向に変化する場合でも、安定した線引きを行って、線引 き後の光ファイバ40aの外径を一定に保持することが可能になる。また、炉心 管21の酸化を抑制して、炉心管21の寿命を延ばすことができる。

[0041]

なお、本発明の光ファイバの線引き方法及び線引き装置は、前述した実施形態 に限定されるものでなく、適宜な変形、改良等が可能である。

上述した実施の形態では、線引き炉に下部シールリングを用いた構成で説明したが、本発明は下シャッターを用いない場合でも、適用可能である。

[0042]

【発明の効果】

以上、説明したように、本発明にかかる光ファイバの線引き方法及び線引き装置によれば、光ファイバ母材にガスを吹き付けると共に、線引き炉の上部及び下部に設けられているシールリングにより線引き炉内をシールし、この線引き炉内に光ファイバ母材を送り込みながら光ファイバ母材の先端部を加熱溶融して光ファイバを製造する際に、線引き炉に供給される光ファイバ母材の外径または線引き炉の気圧に従ってシールリングの内径を変化させながらガスを吹き付ける。このため、光ファイバ母材の外径が変化しても、安定して線引きを行うことができる。

【図面の簡単な説明】

図1

本発明に係る光ファイバの線引き方法及び線引き装置の実施形態を示す構成図である。

図2

上部シールリングを閉じた状態を示す平面図である。

【図3】

上部シールリングを開けた状態を示す平面図である。

【図4】

光ファイバ母材が偏心している場合を示す平面図である。

【図5】

種々の光ファイバ母材の長手方向に対する外径の変化の状態を示すグラフである。

【図6】

母材Aについて線引き後の光ファイバの外径の測定値を示すグラフである。

【図7】

母材Bについて線引き後の光ファイバの外径の測定値を示すグラフである。

【図8】

母材Cについて線引き後の光ファイバの外径の測定値を示すグラフである。

【図9】

母材Dについて線引き後の光ファイバの外径の測定値を示すグラフである。

【図10】

従来における光ファイバ母材の長手方向に対する外径の変化の状態を示すグラフである。

【図11】

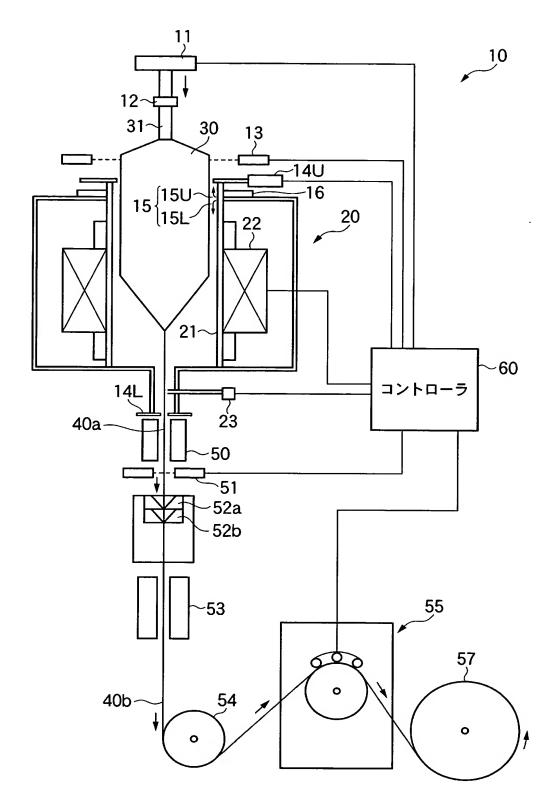
従来における線引き後の光ファイバの外径の測定値を示すグラフである。

【符号の説明】

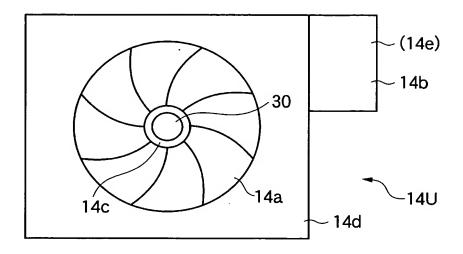
- 10 光ファイバの線引き装置
- 13 母材外径測定手段
- 14b シールリング駆動装置
- 14 e シールリング移動装置
- 14U 上部シールリング
- 14L 下シャッター
- 15 ガス
- 20 線引き炉
- 23 差圧計(内圧測定手段)
- 30 光ファイバ母材
- 40a ガラスファイバ
- 40b 光ファイバ
- 60 シールリング駆動装置制御機構(コントローラ)

【書類名】 図面

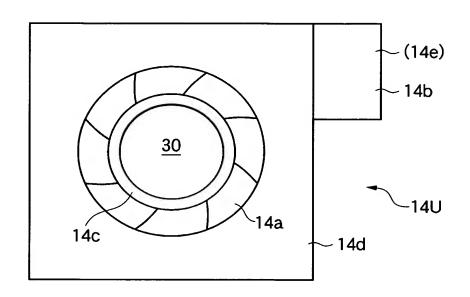




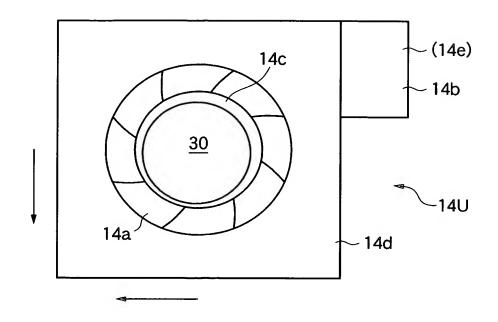
【図2】



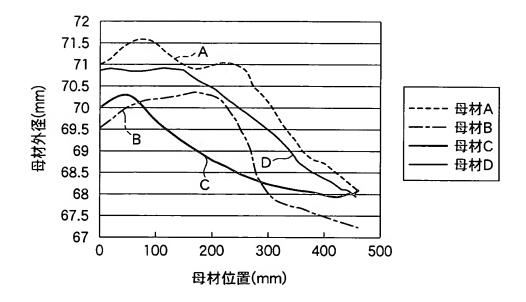
【図3】



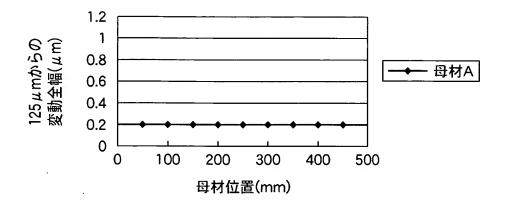
[図4]



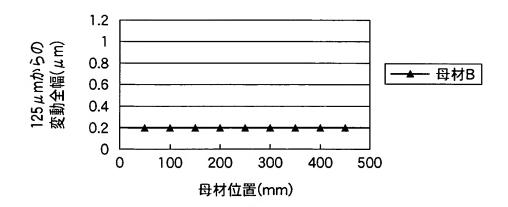
[図5]



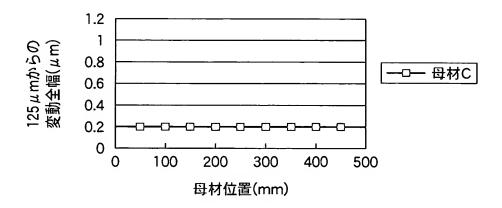
【図6】



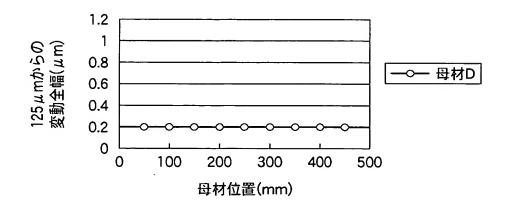
【図7】



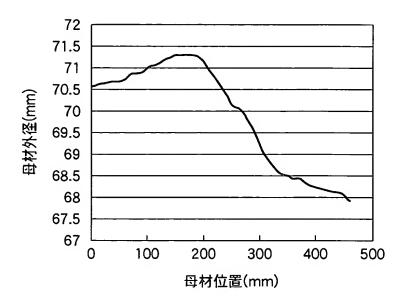
[図8]



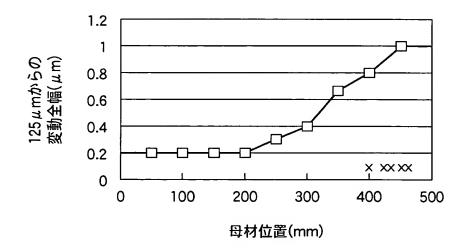
【図9】



[図10]



[図11]



ページ: 1/E

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ガスシール線引きを安定して行うことのできる光ファイバの線引き方 法及び線引き装置を提供する。

【解決手段】 光ファイバ母材30にガス15を吹き付けると共に、線引き炉20の上部及び下部に設けられているシールリング14U、14Lにより線引き炉20内をシールし、この線引き炉20内に光ファイバ母材30を送り込みながら光ファイバ母材30の先端部を加熱溶融して光ファイバ40bを製造する際に、線引き炉20に供給される光ファイバ母材30の外径に従って上部シールリング14Uの内径を変化させながらガス15を吹き付ける。このため、光ファイバ母材30の外径が変化しても、光ファイバ母材30と上部シールリング14Uとの隙間を一定に保つことができるので、安定して線引きを行うことができる。

【選択図】 図1

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2002-329914

受付番号

5 0 2 0 1 7 1 6 3 7 2

書類名

特許願

担当官

第五担当上席 0094

作成日

平成14年12月 9日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成14年11月13日

特願2002-329914

出願人履歴情報

識別番号

[000002130]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月29日

新規登録

住 所

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

氏 名

住友電気工業株式会社